## Device and method for examining an object and for affecting the object

Patent number:

DE4325724

**Publication date:** 

1995-02-02

Inventor: Applicant: DEBBAGE PAUL DR (DE) DEBBAGE PAUL DR (DE)

Classification:

- international:

A61N5/06; G01N21/25; G01N23/08; G02B21/00; H01J37/252; A61N5/06; G01N21/25; G01N23/02; G02B21/00; H01J37/252; (IPC1-7): G01N23/00; A61B6/00; A61B10/00; A61N5/06; A61N5/06; G01N21/00; G01N21/17; G01N21/62; G02B21/00; H01J37/256

- european:

A61N5/06C2; G01N21/25C; G01N23/08; G02B21/00M4; H01J37/252

Application number: DE19934325724 19930730 Priority number(s): DE19934325724 19930730

Report a data error here

## Abstract of DE4325724

The Invention relates to a device and method for examining an object and for affecting the object, the radiation emitted by an object being detected by a detector which produces a corresponding detector signal. This detector signal is subsequently processed such that a non-focusing apparatus for directed exposure of the partial surface of the object can be controlled as a function of the detector signal.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(9) BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

## ① Offenlegungsschrift① DE 43 25 724 A 1



G 02 B 21/00 A 61 B 10/00 H 01 J 37/256 A 61 N 5/10 G 01 N 21/00 G 01 N 21/17 G 01 N 21/62 A 61 B 6/00 A 61 N 5/06



DEUTSCHES PATENTAMT

 ② Aktenzeichen:
 P 43 25 724.0

 ② Anmeldetag:
 30. 7.93

 ③ Offenlegungstag:
 2. 2.95

(1) Anmelder:	DE 38 20 862 A1
Debbage, Paul, Dr., 86415 Mering, DE	DE 36 36 506 A1 DE 33 19 203 A1
(74) Vertreter:	DE 30 40 831 A1
vertieter.	DE 29 53 050 A1
Tetzner, M., DiplIngUniv., PatAnw.; Tetzner, V.,	DE 92 02 539 U1
DiplIng. DrIng. Dr.jur., Pat u. Rechtsanw., 81479	US 50 57 102
München	US 50 08 907
,	US 49 95 068
② Erfinder:	US 48 15 448
	US 44 23 736
gleich Anmelder	US 37 94 840
	EP 04 68 255 A2
66) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit	WO 91 10 473
in Betracht zu ziehende Druckschriften:	SU 5 53 766
DE 41 28 744 C1	SU 4 05 236
DE 34 39 287 C2	JP 63-300942 A. In: Patents Abstracts of Japan,
DE 28 29 516 C2	P-850,March 31 1989, Vol.13, No.131;
DE 27 43 009 C2	
DE 41 38 111 A1	
DE 40 26 821 A1	
DE 39 08 928 A1	

- (5) Vorrichtung und Verfahren zur Untersuchung eines Objektes und zur Einwirkung auf das Objekt
- Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Untersuchung eines Objekts und zur Einwirkung auf das Objekt, wobei die von einem Objekt ausgehende Strahlung von einem Detektor empfangen wird, der ein entsprechendes Detektorsignal erzeugt. Dieses Detektorsignal wird derart weiterverarbeitet, daß eine nicht fokussierende Einrichtung zur gerichteten Bestrahlung der Teilfläche des Objekts in Abhängigkeit vom Detektorsignal angesteuert werden kann.